

課程名稱 (course name)	(中) 薄膜製程 (U026)				
	(Eng.) Thin Film Processing				
開課系所班級 (dept. & year)	材料系大學部	學分 (credits)	3	授課教師 (teacher)	林克偉
課程類別 (course type)	<input type="checkbox"/> 必修(Mandatory) <input checked="" type="checkbox"/> 選修(Elective)	授課語言 (language)	中文	開課學期 (semester)	上學期
課程簡述 (course description)	(中) 本課程在使學生瞭解薄膜製程的基本原理，包括濺鍍，鍍膜，真空技術，氣體之動力理論，吸附與凝結，蒸鍍源等。				
	(Eng.) Understand the knowledge of thin film deposition in high vacuum system and kinetic theory of gases.				
先修課程名稱 (prerequisites)					
課程目標與核心能力關聯配比(%) (relevance of course objectives and core learning outcomes)			課程目標之教學方法與評量方法 (teaching and assessment methods for course objectives)		
課程目標(中/Eng.)	核心能力	配比(%)	教學方法	評量方法	
本課程目的在使學生瞭解薄膜製程的基本原理，包括濺鍍，鍍膜，真空技術，氣體之動力理論，吸附與凝結，蒸鍍源等。 Obtain the knowledge of thin film deposition in high vacuum system and kinetic theory of gases.	<input checked="" type="checkbox"/> 1.運用數學、科學及材料工程知識能力	40	習作 實習 講授 參訪	作業 測驗	
	<input checked="" type="checkbox"/> 2.設計與執行材料實驗及分析數據之能力	10			
	<input checked="" type="checkbox"/> 3.執行材料工程實務所需之技術與能力	20			
	<input checked="" type="checkbox"/> 4.製程整合及元件實作之能力	20			
	<input checked="" type="checkbox"/> 5.溝通協調之能力與團隊合作之精神	10			
	<input type="checkbox"/> 6.獨立思考、解決問題、終身學習之習慣與能力				
	<input type="checkbox"/> 7.培養國際觀及認識綠色材料對全球環境的影響				
	<input type="checkbox"/> 8.瞭解材料工程人員的社會責任與專業倫理				
授課內容(單元名稱與內容、習作/考試進度、備註) (course content and homework/ tests schedule)					
1.Introduction to PVD -PVD technologies and basic physical science					

- 2.The Kinetic Theory of Gases
 - Statistics
 - Collisions, Properties, and Gas Flow
- 3.Adsorption and Condensation
 - Vapor pressure
- 4.Principles of High Vacuum
 - Basic vacuum concepts
 - Operation principles
- 5.Evaporation sources
 - The effusion cell
 - Pulsed laser deposition
- 6.Principles of Sputtering Discharges
 - Sputtering arrangements
 - Plasma, current densities, and potentials
- 7.Sputtering
 - Characteristics
- 8.Film deposition
 - Incident flux and film deposition rate

**學習評量方式
(evaluation)**

Midterm (30%), Final (40%), On-site (20%), Quiz (10%).

**教科書&參考書目 (書名、作者、書局、代理商、說明)
(textbook& other references)**

Physical Vapor Deposition of Thin Film, J. E. Mahan, John Wiley and Sons, Inc., New York (2000) 民
全書局(02-23651662).

**課程教材 (教師個人網址請列在本校內之網址。)
(teaching aids & teacher's website)**

Refer to dept. website.

課程輔導時間(office hours) Friday morning 10am-12pm